# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



#### **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

61062858

**PUBLICATION DATE** 

31-03-86

APPLICATION DATE

04-09-84

APPLICATION NUMBER

59186160

APPLICANT: HITACHI ENG CO LTD;

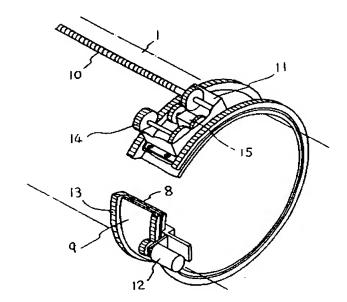
INVENTOR: ASANO KUNITAKA;

INT.CL.

G01N 29/04

TITLE

AUTOMATIC FLAW DETECTOR



#### ABSTRACT:

PURPOSE: To achieve a smaller size of a flaw detector, by a method wherein a rotary orbit is provided on a stationary orbit on the circumference of a cylindrical object, a flaw detection body moving unit mounted thereon and a driving source set outside the rotary orbit for the rotary orbit and a probe moving mechanism.

CONSTITUTION: A stationary orbit 8 is mounted on the circumference of a cylindrical object 1 to be inspected like a piping. A rotary orbit 9 turns on the stationary orbit. A probe moving screw 10 mounted on a flaw detection body moving unit 11 moves a probe coaxially with respect to the cylindrical object 11. The flaw detection body moving unit 11 rotates circumferentially with respect to the cylindrical object 1 together with the rotary orbit 9 driven by a driving source 12. The distance of the unit 11 moved in the circumferencewise direction of the cylindrical object 1 is indexed with deceleration/indexing mechanism 15 by the rotation of a pinion 14 following the unit 11. The unit 11 moves at a fixed distance in the circumferencewise direction of the cylindrical object I and a probe moving screw 10 is turned to move the probe at a fixed distance axially with respect to the cylindrical object 1.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

#### ® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-62858

@Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)3月31日

G 01 N 29/04

G - 6558 - 2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

₿発明の名称	自動探傷装置
--------	--------

创特 願 昭59-186160

⑫出 願 昭59(1984)9月4日

日立市幸町3丁目2番1号 日立エンジニアリング株式会 裕 ⑫発 明 者 木 村

明 日立市幸町3丁目2番1号 日立エンジニアリング株式会 20発 明 者 赤

社内 日立市幸町3丁目2番1号 日立エンジニアリング株式会 國 隆 (72)発

社内

株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

日立市幸町3丁目2番1号 日立エンジニアリング ①出 願 人

株式会社

弁理士 長崎 博男 外1名 の代 理 人

#### 発明の名称 自動探傷装置

人

#### 特許請求の範囲

の出 願

1. 円筒状物体の外周面に取り付けられる軌道と、 当該軌道に沿つて円筒状物体の周方向に回転する 探傷本体移動ユニットと、探傷本体移動ユニット に装着されて円筒状物体の軸方向に探触子を移動 させる探触子移動機構とを備えてなる自動探傷袋 置において、上記軌道として、円筒状物体の外周 面に固定軌道を取り付けるとともに、当該固定軌 道上に回転軌道を取り付け、さらに上記回転軌道 に探傷本体移動ユニットを装着するとともに、回 転軌道と探触子移動機構との駆動源を回転軌道の 系外に設置してなることを特徴とする自動操傷装 避。

2. 特許請求の範囲第1項記載の発明において、 回転軌道の駆動源と採触子移動機構の駆動源とを、 その双方の被駆動体に共通する1個の駆動源とし た自動探傷裝置。

発明の詳細な説明

#### 「発明の利用分野う

本発明は、たとえば配管のごとき円筒状物体の 外周面を走行して当該検査物体に生じたひび割れ、 その他の欠陥を自動的に探傷する自動探傷装置の 改良に関するものである。

#### [発明の背景]

本発明の説明に先立ち、従来與用に供されてい る自動探傷装置の全体檘成を第8図にもとづいて 説明する。

第8図において、1は検査対象物である配管の **どとき円筒状物体、2は円筒状物体1の外周面に** 取り付けられた軌道、3は軌道2上を走行する探 傷本体移動ユニット、4は円筒状物体1の軸方向 に探触子5を移動させる探触子移動わじを示し、 探傷本体移動ユニツト 3 内にけ、 当該 ユニット 3 を軌道2に沿つて円筒状物体1の周方向(X方向) に回転させるDCモータなどの財動源6と、探触 子移動ねじ4を回転して探触子5を円筒状物体1 の軸方向(Y方向)に移動させる駆動源?とが内 敵されている。

(1)

(2)

途に応じた配管が数多く布設されており、したが つてこれら各種配管を採協検査する頻度も当然多

しかしながら、従来形自動探傷装置にあつては、 第8図に示すことく、探傷本体移動ユニット3内 に 2 茜の椒動顔、すなわち当眩ユニツト 3 を軌道 2 に沿つて円筒状物体 1 の周方向(X方向)に走 行させる駆動源6と、探触子移動ねじ4を回転し て探触子5を円筒状物体1の軸方向(Y方向)に 移動させる駆動源1とを内蔵しており、探傷装置 そのものの小形化に限度があるため、自動探傷装 置を適用し得る個所が制限され、この種検査に多 くの時間と労力とを必要としていた。

なお、原子力関係の調査報告例によれば、従来 形自動採傷裝置の高さ寸法が40㎜短縮されれば、 原子力発電プラント内における自動探傷装置の適 用率は、約10%向上するといわれている。

また、従来形自動探傷装置にあつては、第8図 に図示を省略したが、探傷本体移動ユニツト3 に (3)

を取り付けるとともに、当該固定軌道上に回転軌 道を取り付け、さらに上記回転軌道に採傷本体移 動ユニットを装着するとともに、回転軌道と探触 子移助機構との駆動源を回転軌道の系外に設置し てなることを特徴とするものである。

#### 〔発明の実施例〕

以下、本発明を、第1図ないし第3図の一実施 例にもとづいて説明すると、第1図は本発明に係 る自動探傷装置の全体構成を示す一部切欠斜視図 である。

第1図において、1は検査対象物である配管の ととき円筒状物体、8は円筒状物体1の外周面に 取り付けられた固定軌道、9は後述の構成によつ て固定軌道8上を回転する回転軌道、10は円筒 状物体1の軸方向に探触子(図示省略)を移動さ せる探触子移動ねじを示し、探触子移動ねじ10 は、探傷本体移動ユニツト11に装剤されている。 また、探傷本体移動ユニット11は、回転軌道9 にねじ止めされている。

探傷本体移動ユニツト11を拡大して示す第2

ところで、原子力発電ブラント内には、各種用・・・・・内蔵された2基の駅動源6と7とにそれぞれケー プルが接続されており、これらのケープルが探傷 本体移動ユニット3の走行にともなつて移動する ・ ため、ケープル捌きに人手を必要としていた。

#### . (発明の目的)

本発明は、以上の点を考慮してなされたもので あつて、その目的とするところは、探仏装置の走 行部を小形化して原子力発電プラント内における 自動探傷装置の適用率を従来よりも向上させると とができ、しかも従来おこなわれていたこときヶ ープル捌きを全く必要としない、作業性にすぐれ た自動探傷装置を提供しようとするものである。 [発明の概要]

上記目的を遊成するため、本発明は、円筒状物 体の外周面に取り付けられる軌道と、当該軌道に 沿つて円筒状物体の周方向に回転する探傷本体移 助ユニツトと、探傷本体移動ユニツトに装着され て円筒状物体の動方向に探触子を移動させる探触 子移動機構とを備えてなる自動探傷装置において、 上記軌道として、円筒状物体の外周面に固定軌道

図(平面図) および第3図(一部縦断正面図) に おいて、回転軌道9は、固定軌道8に取り付けら れたDCモータなどの駆動源12Kよつて駆動さ れ、探傷本体移動ユニット11は、回転軌道9と ともに円筒状物体1の周方向に回転する。また、 探傷本体移動ユニット11には、間定軌道8に散 けられたラツク13とかみ合うピニオン14が装 **着されており、探傷本体移動ユニット11が円筒** 状物体1の周方向を回転することにより、ピニオ ン14も当該ユニツト11と河方向に回転する。 探傷本体移動ユニット11が円筒状物体1の周方 向を移動する距離は、当該ユニット11に従動す るピニオン14の回転により、減速・割出し機構 15によつて割り出され、探傷本体移動ユニット 11が円筒状物体1の周方向を一定距離移動する と、探触子移動ねじ10が回転して図示を省略し た探触子を円筒状物体1の軸方向に一定距離移動 させる。その走査軌跡を第7図(a)に符号と、で示 す。

なお、上記契施例においては、風動源12を固

定軌道8の端部に取り付けた場合について例示したが、これに代えて、駆動原12を固定軌道8から取り外して別設置とし、この別設置された駆動源からの回転駆動力により、第2図に一点鎖線で示すフレキシブルワイヤ機構16を介して回転軌道9を回転させるようにしてもよく、さらに駆動源12として、ステッピングモータあるいはエンコータを付設したモータなどを使用することに問題はない。

また、図示を省略したが、第1図ないし第3図の実施例においては、探傷本体移動ユニット11が円筒状物体1の周方向に往復移動しても、円筒状物体1の軸方向に移動する探触子が常に一方向に移動して第7図(a)に示す走査軌跡 L1を得ることができるよう、探傷本体ユニット11内に一方向クラッチが組み込まれている。

さらに、第1図ないし第3図に示す実施例によって得られる探触子の走査軌跡と、は、第7図(a)に示すごときX-Y走査による軌跡であるが、第7図(b)に示すごときY-X走査による軌跡と、を

(7)

体移動ユニット 2 0 の他側には、回転軌道 1 8 に 設けられたラック 2 5 とかみ合うピニオン 2 6 が 装着されている。 第 6 図中、 2 7 および 2 8 は探 協本体移動ユニット 2 0 の走行車輪を示している。

しかして、探傷本体移動ユニット20に装着されているピニオン26をクラッチ29を介して当該ユニット20にロックさせると、探傷本体移動ユニット20は、回転軌道18とともに円筒状物体1の周方向に回転される。なお、このとき、固定軌道17のラック23とかみ合つているピニオン24は、回転フリーの状態としておく。

次に、ビニオン26を回転フリー、ビニオン24をクラッチ29を介して採傷本体移動ユニット20にロックさせると、当該ユニット20は停止する。一方、ビニオン26は、回転フリーの状態にあるため、回転軌道18の回転にともなつてその位置で回転し、ギャ30ないし33を介して探触子移動ねじ19の回転により、図示を省略した探触子が円筒状物体1の軸方向に移動する。な

得ることのできる自移探傷装置の一例を第4図ないし第6図に示す。

探傷装置の全体構成を一部切欠斜視図として示す第4図において、1は検査対象物である配質のどとき円筒状物体、17は円筒状物体1の外周面に取り付けられた固定軌道、18は後述の構成によつて固定軌道17上を回転する回転軌道、19は円筒状物体1の軌方向に探触子(図示省略)を移動させる探触子移動ねじを示し、探触子移動ねじ19は、探傷本体移動ユニット20に装着されている。なお、上記した探傷本体移動ユニット20は、パント21を介して固定軌道17の外周に装着されている。

探傷本体移動ユニット20を拡大して示す第5図(平面図)および第6図(一部縦断正面図)において、回転軌道18は、固定軌道17に取り付けられたDCモータなどの駅動源22によつて駅動される。また、探傷本体移動ユニット20の一側には、固定軌道17に設けられたラック23とかみ合うビニオン24が装着されており、探傷本

(8)

お、探触子を円筒状物体1の軸方向に往復動させるためには、回転軌道18の回転を正逆変化させるか、第4図および第5図に符号34で示す回転方向変換クラッチを探傷本体移動ユニット20内に装着しておくことにより、第7図(b)に示すこときY-X走査による軌跡と。を得ることができる。 [発明の効果]

本発明は以上のごときであり、本発明においては、円筒状物体の外周面に固定軌道を取り付けるとともに、当該固定軌道上に回転軌道を取り付け、さらに上記回転軌道に探傷本体移動ユニットを装着するとともに、回転軌道と探触子移動機構との駆動源を回転軌道の系外に設置したことにより、上記回転軌道と探触子移動機構との駆動源を回転軌道の系外に設置しても、検査対象物である円筒状物体の探傷を支障なくおこない得るものであつて、その効果は下記のとおりである。

すなわち、回転軌道と探触子移動機構との駅動 源を回転軌道の系外に散催することにより、円筒 状物体の外周を走行する探傷装置の小形化をはか

(10)

ることができ、実機に照らして寸法計算をおこれつたところ、探傷装置の大きさを従来よりも 1/3 程度小形化できることが確認され、 軽置の高さ寸 法の大幅短縮化も確認された。しかして、 本発明に なかいては、 特に、 探傷装置の高さ寸 法を大幅に なができるとにより、 自動探傷装置を 通用した 原 子力発電ブラント内における 自動探傷装置の 用 本 を向上させることができるものであつて、 探傷 大変 着とセパレートタイプとした 駆動に応じて、 適宜の場所に 設置することができ、 機動性に 宮む。

また、本発明においては、駆動源が探傷本体移動ユニットの走行にともなつて移動することがないので、従来のように、駆動源に接続されているケーブルを人手によつて捌くといつた作業を省略することができる。

さらに、図示実施例のどとく、回転軌道の駆動 源と探触子移動機構の駆動源とを、その双方の被 駆動体に共通する1個の駆動源とすれば、探傷装 (11)

世の一実施例を示し、第1図はその全体構成を示す一部切欠斜視図、第2図は第1図の平面図、第3図は第1図の一部を経断して示す正面図、第4図ないし第6図は本発明に係る自動探傷装置のの実施例を示し、第4図はその全体構成を示すの切欠斜視図、第5図は4図の平面図、第7図は第4図の一部を経断して示す自動探傷装置の走査軌跡を三次元的に表わした図、第7図(b)は第4図ないし第6図に示す自動探傷装置の走査軌跡を三次元的に表わした図、第8図は従来形自動探傷装置の全体機成を示す斜視図である。

1 …円筒状物体、8 …固定軌道、9 …回転軌道、10 …探触子移動ねじ、11 …探傷本体移動ユニット、12 …駆動源、13 …ラック、14 …ピニオン、15 …液速割出し機構、16 …フレキシブルワイヤ機構、17 …固定軌道、18 …回転軌道、19 …探触子移動ねじ、20 …探傷本体移動ユニット、21 …バント、22 …駆動源、23 …ラック、24 …ピニオン、25 …ラック、26 …ピニ

置の制御系を簡繁化することができるばかりか、 重量の軽減化をもはかり得、電源も1つで事足り

ととて、本発明の付随的効果を下記する。

- (2) 上記(1)の理由により、1台の探傷装置の駆動 源を他の探傷装置の駆動源としても共用するこ とができ、経済的である。

本発明は以上のどときであり、本発明によれば、 探傷装置の走行部を小形化として原子力発電ブラント内における自動探傷装置の適用率を従来より も向上させることができ、しかも従来おこなわれ ていたどときケーブル捌きを全く必要としない、 作楽性にすぐれた自動探傷装置を得ることができる。

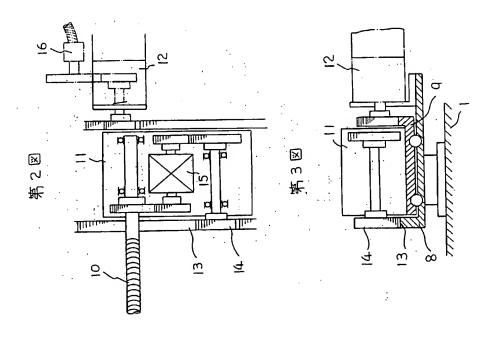
#### 図面の簡単な説明

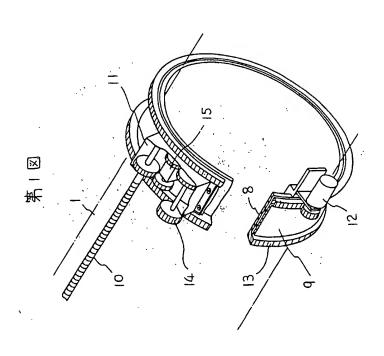
第1図ないし第3図は本発明に係る自動探傷装 (12)

オン、 2 でおよび 2 8 …走行車輪、 2 9 … クラッチ、 3 0 ~ 3 3 …ギヤ、 3 4 …回転方向変換 クラッチ、 L<sub>1</sub> および L<sub>2</sub> …走査軌跡。

代理人 弁理士 長崎博男 (ほか1名)

(14)





**—367**—

